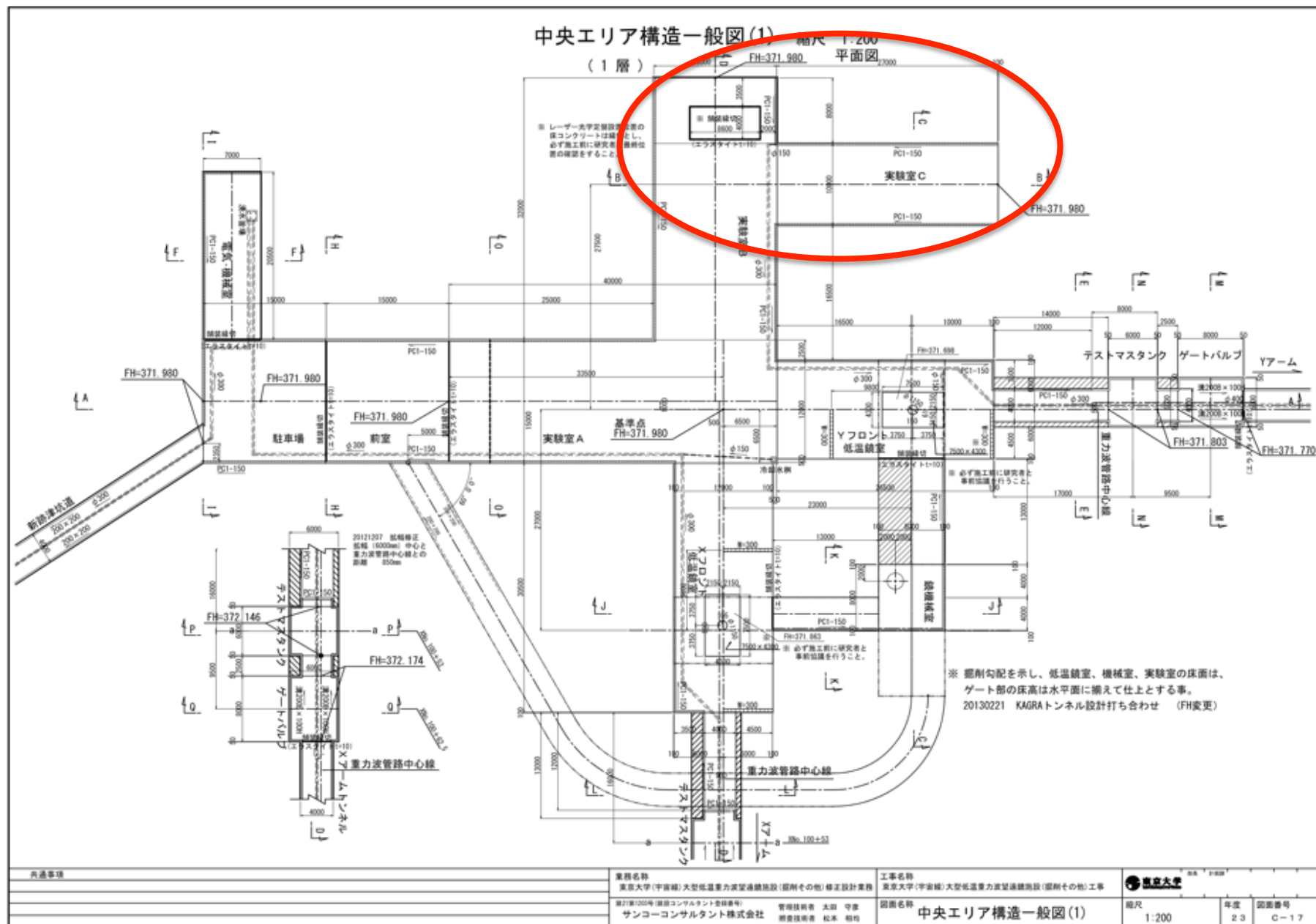


MCEベースプレート測量

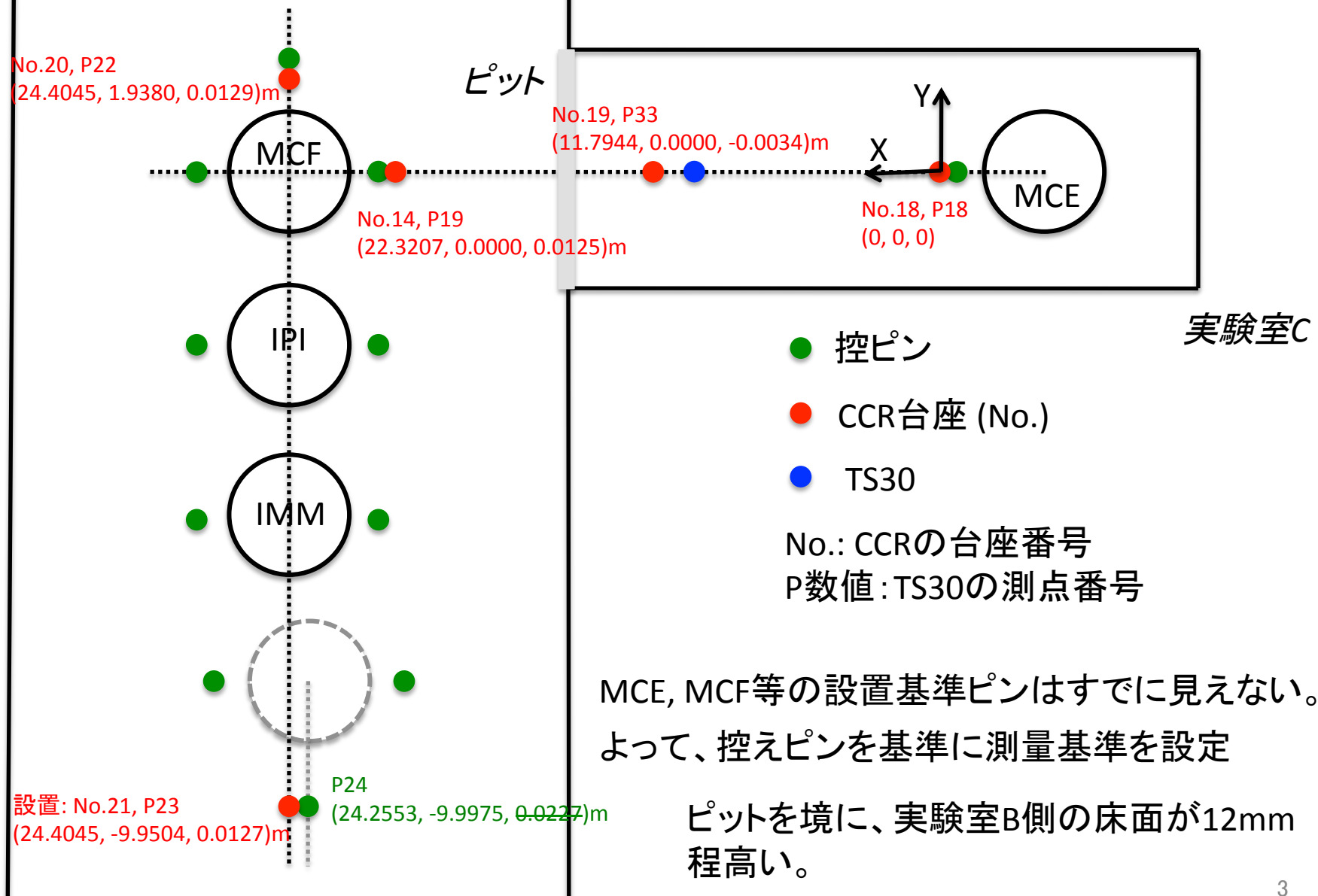
2014.10.27 Chief会議

都丸、加藤(東工大)



実験室B

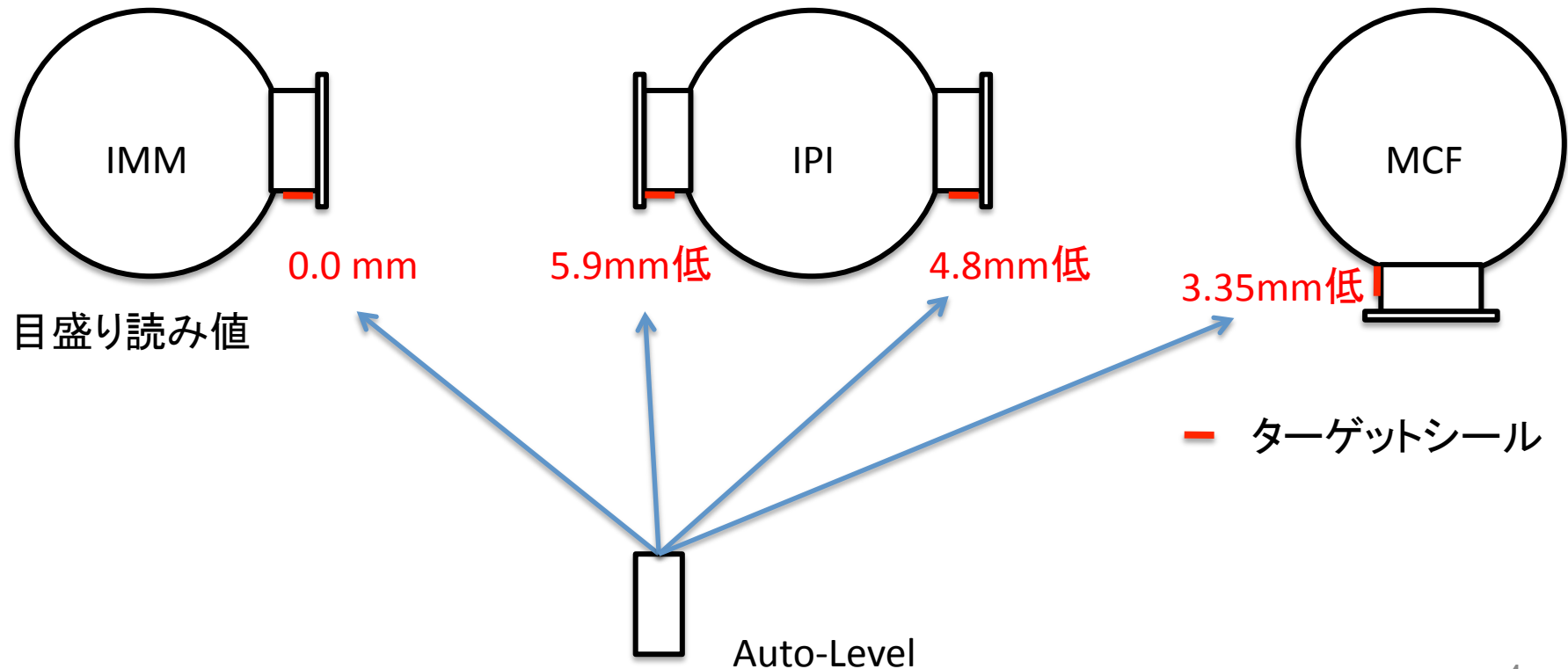
(1) TS30による測量基準点の設定



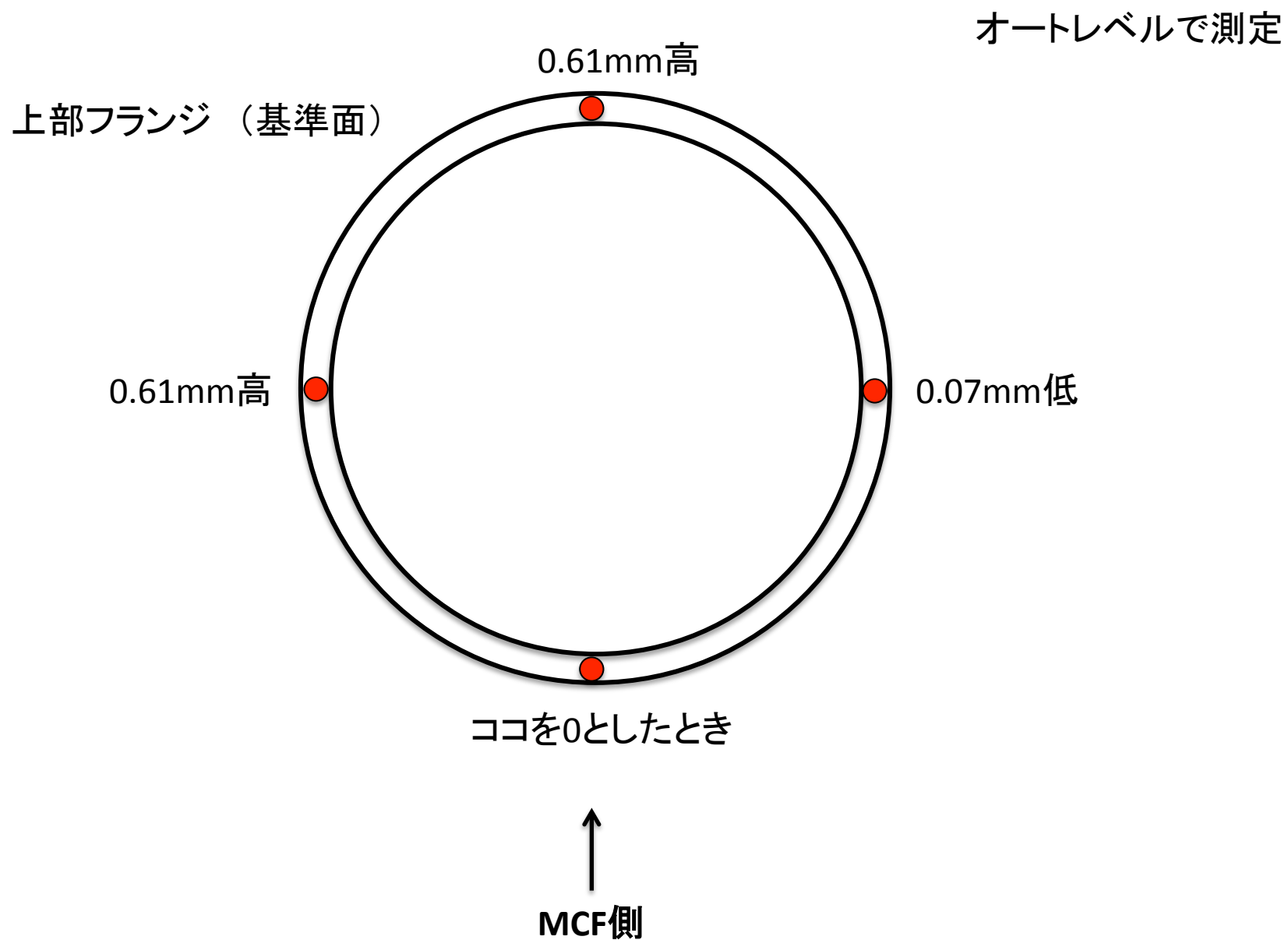
(2) IMM, IPI, MCFの相対的な高さ、傾き

実験室C側からオートレベルで相対的な高さおよび傾きをチェック

これらのチェンバーには高さ基準となるケガキが設けられていない。
しかたないので、サイドフランジ面にある溶接用ケガキにターゲット
シールを貼って、測量。

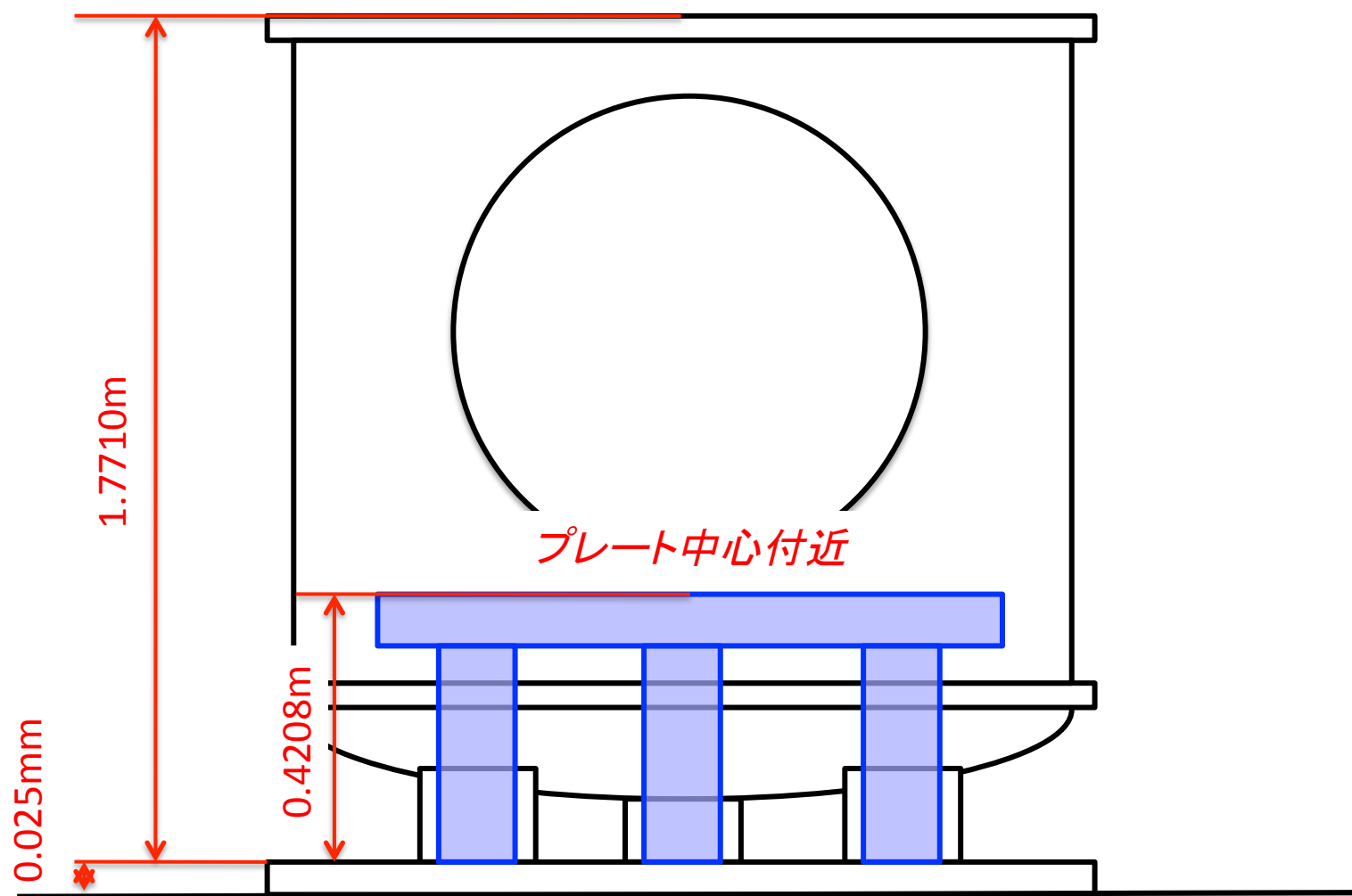


(3) MCEの傾き測定



(4) MCEおよびベースプレートの高さ

TS30



(5) MCEベースプレートの傾き測定

オートレベルで測定

